

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 1 区分
 【発行日】平成 17 年 8 月 11 日 (2005.8.11)

【公開番号】特開 2002-326061 (P2002-326061A)
 【公開日】平成 14 年 11 月 12 日 (2002.11.12)
 【出願番号】特願 2001-170262 (P2001-170262)
 【国際特許分類第 7 版】

B 0 8 B 1/02

B 0 8 B 3/02

【 F I 】

B 0 8 B 1/02

B 0 8 B 3/02 C

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 1 月 19 日 (2005.1.19)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

処理液に浸漬されて軟化した糊剤の付着しているダイシングフレームを供給される搬送部を形成し、この搬送部の搬送途中に供給側から順に、ダイシングフレームの上下面を摺擦するものとしたブラシ装置と、このブラシ装置で摺擦されたダイシングフレームに注水するための注水ノズル部と、ダイシングフレームに付着した水分を空気流により除去するものとした乾燥装置とを設けたことを特徴とするダイシングフレーム洗浄機。

【請求項 2】

真空圧を付与される密閉室を形成し、この密閉室の壁面にダイシングフレームに適合させた細長状の透孔を設けると共に、ダイシングフレームを前記透孔の存在箇所を通過するように搬送する搬送部を設け、ダイシングフレームが前記透孔の存在箇所を通過するとき、このダイシングフレームに付着した水分が前記真空圧の生じさせた密閉室外方からその内方へ向かう空気流により流動飛散され前記真空圧の影響する環境下で蒸発される構成を特徴とするダイシングフレーム乾燥装置。

【請求項 3】

真空圧を付与される密閉室を形成し、この密閉室の前壁面と後壁面とにダイシングフレームの厚さと直径とに適合させた細長状の透孔を設けると共に、ダイシングフレームを前記 2 つの透孔を通じて密閉室を通過するように搬送する搬送部を設け、ダイシングフレームが各透孔を通過するとき、このダイシングフレームに付着した水分が前記真空圧の生成させた密閉室外方からその内方へ向かう空気流により流動飛散され密閉室内で真空圧下で蒸発される構成を特徴とするダイシングフレーム乾燥装置。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 0 7 】

また請求項 2 に記載したダイシングフレーム乾燥装置では、真空圧を付与される密閉室を形成し、この密閉室の壁面にダイシングフレームに適合させた細長状の透孔を設けると

共に、ダイシングフレームを前記透孔の存在箇所を通過するように搬送する搬送部を設け、ダイシングフレームが前記透孔の存在箇所を通過するとき、このダイシングフレームに付着した水分が前記真空圧の生じさせた密閉室外方からその内方へ向かう空気流により流動飛散され前記真空圧の影響する環境下で蒸発される構成となす。

さらに詳細には、請求項 3 に記載したように、真空圧を付与される密閉室を形成し、この密閉室の前壁面と後壁面とにダイシングフレームの厚さと直径とに適合させた細長状の透孔を設けると共に、ダイシングフレームを前記 2 つの透孔を通じて密閉室を通過するように搬送する搬送部を設け、ダイシングフレームが各透孔を通過するとき、このダイシングフレームに付着した水分が前記真空圧の生成させた密閉室外方からその内方へ向かう空気流により流動飛散され密閉室内で真空圧下で蒸発される構成となす。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0034

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0034】

請求項 2 又は 3 に記載した乾燥装置によれば、ダイシングフレームをこれの表面に不純物の付着しないように高速で乾燥させることができるものである。